

水平爐管

考核項目清單

※水平爐管各別原理

請查詢 NDL 網站內水平爐管的技術資料

網址: http://www.ndl.org.tw/cht/doc/3-1-1-0/T3/T3_B.pdf

- 簡介爐管構造
- 說明每根爐管的反應氣體，反應溫度及其用途
- 分辨 AP 與 LP 爐管.....

※ 操作流程&面板介紹&故障排除

請查詢 NDL 網站內水平爐管的操作手冊

網址: http://www.ndl.org.tw/cht/doc/3-1-1-0/T3/T3_E.pdf

- 登入方法 ★
- Download Program 與執行 Program ★
- 解釋觸控小螢幕的即時資料監控畫面
- 擺放晶片方法及熟練度 (10 分鐘內擺完 25 片 wafer)..... ★
- 紀錄簿填寫方式
- 製程內容介紹(Miscellaneous) –功能列介紹.....
- 製程內容介紹(Miscellaneous) –LP 爐管 Program 步驟解釋
- 製程內容介紹(Miscellaneous) –LP 爐管 常見問題的原因及解決方法..... ★
- 製程內容介紹(Miscellaneous) –AP 爐管 Program 步驟解釋.....
- 製程內容介紹(Miscellaneous) –AP 爐管 常見問題的原因及解決方法 ★
- LP 爐管之 N2 purge 壓力查詢，壓力上升原因，相關規定，及壓力過高的處理辦法.....
- 會查詢 Analyze 內 Event，及判讀方法。(若 Abort，會查詢 Abort 的步驟)..... ★
- 當系統實際出錯時，處理的方法與熟練度 ★

※ 危機處理

- 機台上公告之危機處理辦法
- 工程師連絡方式 ★
- 監控室聯絡方式 ★

※ 注意事項

請查詢 NDL 網站內水平爐管的注意事項

網址: http://www.ndl.org.tw/cht/doc/3-1-1-0/T3/T3_D.pdf

- 爐管使用資格與考核資格
- 紀錄簿填寫規則 ★
- 收貨時間及注意事項
- 晶片限制 ★
- LPCVD 操作完後，離開時的注意事項
- 學生使用時間限制